

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



**ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORPORATION LIMITED**

**上海先進半導體製造股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股份代號：03355)

### 根據上市規則13.09條刊發之公告

上海先進半導體製造股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司之液體與氣體供應商錯誤地更換並再連接四氯化矽槽體，造成部分該液體被洩漏至本公司5英寸晶片生產設施的生產區域(「該事件」)。四氯化矽是被用於本公司部分半導體生產工藝中。

於該事件發生時，該事件並未對於生產設施工作的本公司雇員造成任何傷害。

但是，經過本公司管理層詳盡地衡量與評估，董事會推斷四氯化矽液體洩漏於空氣中可能會緩慢地造成本公司5英寸生產線及6英寸生產線(部分)的淨化室設施受到危及與損害。

因此，董事會決定於2009年10月後期對本公司5英寸生產線及6英寸生產線(部分)的淨化室設施進行全面的維護檢修，由此造成5英寸生產設施及6英寸生產設施(部分)必須停止運行約一周。董事會預期，由於該事件造成檢修淨化室設施、晶片報廢及業務中斷而產生的損失，將對本公司的營運以及截至2009年12月31日止3個月的業績造成不良影響。

**建議本公司股東及投資者在買賣本公司股份時務須謹慎行事。**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 13.09 條刊發。

上海先進半導體製造股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於本公司之液體與氣體供應商錯誤地更換並再連接四氯化矽槽體，造成部分該液體被洩漏至本公司 5 英寸晶片生產設施的生產區域（「該事件」）。四氯化矽是被用於本公司部分半導體生產工藝中。

於該事件發生時，該事件並未對於生產設施工作的本公司雇員造成任何傷害。

但是，經過本公司管理層詳盡地衡量與評估，董事會推斷四氯化矽液體洩漏於空氣中可能會緩慢地造成本公司 5 英寸生產線及 6 英寸生產線（部分）的淨化室設施受到危及與損害。

因此，董事會決定於 2009 年 10 月後期對本公司 5 英寸生產線及 6 英寸生產線（部分）的淨化室設施進行全面的維護檢修，由此造成 5 英寸生產設施及 6 英寸生產設施（部分）必須停止運行約一周。董事會預期，由於該事件造成檢修淨化室設施、晶片報廢及業務中斷而產生的損失，將對本公司的營運以及截至 2009 年 12 月 31 日止 3 個月的業績造成不良影響。

本公司已通知該液體與氣體供應商，本公司將保留所有的權利，對因該事件所引致的所有的損失進行索賠。目前，董事會無法確切地估計該事件對本公司造成的財務影響，也無法於目前的情形下確定可由該供應商處獲償的金額。本公司將於截至 2009 年 9 月 30 日止 3 個月的業績公告內提供關於該事件的進一步更新訊息，以及如果有關於該事件的額外的重大進展，刊發進一步的公告。

**建議本公司股東及投資者在買賣本公司股份時務須謹慎行事。**

承董事會命  
上海先進半導體製造股份有限公司  
執行董事、總裁及首席執行長  
周衛平

中國上海，2009 年 10 月 9 日

於本公告公佈日期，本公司以周衛平和程堅玉為執行董事；以陳建明、諸培毅、朱健、李智、葉昱良及 Christopher Paul Belden 為非執行董事；及以 Thaddeus Thomas Beczak、沈偉家及 James Arthur Watkins 為獨立非執行董事。